

**Сведения об официальном оппоненте
(согласие на оппонирование)**

Я, Оскирко Владимир Олегович, согласен быть официальным оппонентом Апасова В.И. по кандидатской диссертации на тему «Разработка и исследование комбинированного понижающе-повышающего преобразователя системы электроснабжения автоматического космического аппарата» по специальности 05.09.12 – Силовая электроника.

О себе сообщаю

Ученая степень — кандидат технических наук.

Шифр и наименование специальности: 05.09.12 Силовая электроника

Должность: научный сотрудник

Место и адрес работы: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт сильноточной электроники Сибирского отделения Российской академии наук (ИСЭ СО РАН), Россия, 634055, г. Томск, проспект Академический, 2/3

Телефон: 89234221100

e-mail (оппонента): oskirkovo@gmail.com

Перечень опубликованных работ по специальности оппонируемой диссертации:

1. Оскирко В.О., Павлов А.П., Семёнов В.А. Источники питания для симметричного и ассиметричного дуального магнетронного распыления // Известия высших учебных заведений. Физика. 2015. Т. 58. № 9-2. С. 227-231.
2. Оскирко В.О., Семенов В.Д., Павлов А.П. Исследование формирователя биполярных импульсов для питания магнетронных распылительных систем // Доклады ТУСУР. 2015. № 3 (37). С. 39
3. Оскирко В.О., Семенов В.Д., Павлов А.П. Применение демпфирующих цепей в импульсном источнике питания магнетронных распылительных систем // Вестник Московского авиационного института. 2015. Т. 22. № 4. С. 168-176.
4. Семенов В.А., Оскирко В.О., Соловьев А.А., Работкин С.В. Ионное воздействие на подложку в процессе сильноточного импульсного магнетронного осаждения пленок меди. Известия высших учебных заведений. Физика. 2016. Т. 59. № 9-3. С. 284-289.
5. Сочугов Н.С. Источник питания для магнетронных распылительных систем / Н.С. Сочугов, В.О. Оскирко, Р.Е. Спирин // ПТЭ. – 2013, № 2. – С. 62–68.

6. Оскирко В.О. Модульный биполярный источник питания для мощных ионно-плазменных установок / В.О. Оскирко, Н.С. Сочугов, А.П. Павлов // ПТЭ. – М.: МАИК. – 2014, № 5. – С. 85.

В трудах конференций:

1. Оскирко В.О. Биполярные источники питания для мощных ионно-плазменных установок / В.О. Оскирко, Н.С. Сочугов, А.П. Павлов // Материалы VIII Международной научно-технической конференции «Вакуумная техника, материалы и технологии». – М., 2013. – С. 210-214.

2. Оскирко В.О. Биполярные источники питания для мощных ионно-плазменных установок / В.О. Оскирко, Н.С. Сочугов, А.П. Павлов // Труды 11-й международной конференции «Пленки и покрытия-2013». – Санкт-Петербург, 2013. – С. 173-175.

3. Oskirko V.O. Bipolar power supply for reactive magnetron sputtering / V.O. Oskirko, A.A. Sokoviev, A.P. Pavlov, I.V. Ionov, N.S. Socugov // 12th Int. Cong. EFRE. – Tomsk, 2014. – p. 229.

4. Оскирко В.О. Среднечастотный источник электропитания магнетронных распылительных систем на основе однотактного прямоходового двухтранзисторного преобразователя / В.О. Оскирко, А.П. Павлов, А.Н. Одиванова // Труды 12-й международной конференции «Пленки и покрытия-2015». – СПб, 2015. – С. 112-113.

5. Оскирко В.О., Семенов В.Д. Исследование рекуперативных демпфирующих цепей, определяющих траекторию движения рабочей точки при переключении транзистора / В.О. Оскирко, В.Д. Семенов // «Научная сессия ТУСУР - 2015». Том 3. – Томск, 2015 – С. 56 -64.

6. Oskirko V.O. Pavlov A.P. Semenov V.A. Power supply for symmetric and asymmetric dual magnetron sputtering / V.O. Oskirko, A.P. Pavlov, V.A. Semenov // 12th International Conference Gas Discharge Plasmas and Their Applications. – Tomsk, 2015. – p. 109.

Патент

1. Патент на полезную модель 152 232.U1 РФ, МПК Н 01 J 37/32. Биполярный источник питания для магнетронных распылительных систем / В.О. Оскирко, А.П. Павлов, А.А. Соловьев, С.И. Еньшин, В.А. Семёнов (РФ). – № 2 014 137 348 / 07; заявл. 15.09.2014; опубл. 10.05.2015. Бюл. № 13. – 2 с.

« ____ » _____ 2018 г.



Оскирко В.О.

Подпись Оскирко Владимира Олеговича
удостоверяю:

Ученый секретарь ИСЭ СО РАН



Пегель И.В.